

(M320) : 姿勢検出デバイスのシステム化研究 {(株) 村田製作所}

主要論文

- 1) 外山 元夫 他、Characterization of piezoelectric properties of PZT thin films deposited on Si by ECR sputtering、Sensors and Actuators A45(1994) ,p125.
- 2) 田中 克彦 他、A Micromachined Vibrating Gyroscope、MEMS'95、1995.01.29.
- 3) 田中 克彦 他、振動型シリコンマイクロジャイロ、第13回「センサの基礎と応用」シンポジウム、1995.06.08.
- 4) 持田 洋一 他、振動型マイクロジャイロの基礎特性、ロボティクス・メカトロニクス講演会、1995.06.22.
- 5) 持田 洋一、マイクロジャイロの振動特性評価、精密工学会誌 Vol. 63 No. 3、1997. 3.
- 6) 田中 克彦 他、Anodic Bonding of Lead Zirconate Titanate Ceramics to Silicon with Intermediate Glass Layer, Sensors and Actuators A 69 (1998), p199.
- 7) 持田 洋一 他、A Micromachined Vibrating Rate Gyroscope with Independent Beams for the Drive and Detection Modes, MEMS'99, 1999.02.21.
- 8) 川合 浩史 他、Direct Measurement of Mechanical Coupling in Microgyroscope using a Two-Dimensional Laser Displacement Meter, Transducers'99, 1999.6.9.
- 9) 持田 洋一 他、A Micromachined Vibrating Rate Gyroscope with Independent Beams for the Drive and Detection Modes, Sensors and Actuators A 80 (2000), p170.
- 10) 竹村 光治 他、Microgyroscope for Experimental Catheter-type Micromachine, 第5回国際マイクロマシンシンポジウム、1999.10.29.
- 11) 大和田 邦樹 他、Micromachined Silicon Gyroscope, Sensors Update Vol. 6 (Wiley-VCH), 2000.01.01.
- 12) 川合 浩史 他、マイクロジャイロの開発、大分マイクロマシンセミナー、2000.02.10.
- 13) 川合 浩史 他、High-resolution Microgyroscope Using Vibratory Motion Adjustment Technology, Sensors and Actuators A 90 (2001), p153.

主要特許リスト

- 1) 長谷川 友保、角速度センサ、平 5-034534 ; 93. 01. 29. (米国およびE C 出願)
- 2) 持田 洋一 他、角速度センサ、平 5-113910 ; 93. 04. 16. (米国およびE C 出願)
- 3) 森屋 和文 他、振動素子の周波数調整機構、平 6-115898 ; 94. 08. 09.
- 4) 外山 元夫 他、角速度センサ、平 6-230396 ; 94. 08. 31.
- 5) 杉本 正一 他、振動ジャイロ、平 6-211790 ; 94. 08. 12.
- 6) 長谷川 友保 他、角速度センサ、平 6-340439 ; 95. 02. 10.
- 7) 持田 洋一、真空封止デバイスおよびその製造方法、平 7-260876 ; 95. 09. 13.
- 8) 厚地 健一 他、角速度センサ、平 7-308460 ; 95. 11. 01.
- 9) 厚地 健一 他、角速度検出装置、平 8-271678 ; 96. 09. 21.
- 10) 田村 昌弥 他、外力検出装置およびその製造方法、平 8-298030 ; 96. 10. 22.
- 11) 竹村 光治、振動型半導体センサの製造方法、平 8-357183 ; 97. 02. 20.
- 12) 田村 昌弥、外力計測装置およびその製造方法、平 9-26123 ; 97. 01. 24.
- 13) 厚地 健一 他、共振子、平 9-331159 ; 97. 11. 14.
- 14) 田村 昌弥、半導体電子部品装置及びその製造方法、平 10-148329 ; 98. 05. 13.
- 15) 持田 洋一、角速度センサ、平 10-260925 ; 98. 08. 31.
- 16) 厚地 健一、小型電子部品及びその製造方法、平 11-22439 ; 99. 01. 29.
- 17) 川合 浩史、共振素子、平 11-197096 ; 99. 07. 12.
- 18) 川合 浩史、共振素子およびその振動調整方法、平 11-362886 ; 99. 12. 21.
- 19) 田村 昌弥、角速度センサ、平 11-369980 ; 99. 12. 27.
- 20) 厚地 健一、共振素子、特願 2000-001412 ; 00. 01. 07.
- 21) 杉本 正一、ジャイロ装置、特願 2000-339325 ; 00. 11. 07.
- 22) 川合 浩史 他、角速度検出素子、特願 2000-340719 ; 00. 11. 08.
- 23) 田村 昌弥、角速度センサ及びその製造方法、特願 2001-010228 ; 01. 01. 18.